

**解像力 2.0 マイクロメートルで 65 型パネルの一括露光を実現  
FPD 露光装置 “MPAsp-H1003T” を発売**

キヤノンは、第 8 世代ガラス基板サイズ<sup>※1</sup>に対応した FPD 露光装置（フラットパネルディスプレイ露光装置）の新製品として、解像力 2.0 マイクロメートル（L/S<sup>※2</sup>）で 65 型パネルの一括露光を実現した “MPAsp-H1003T” を 2018 年 10 月下旬より発売します。



MPAsp-H1003T

薄型テレビの普及が進む中、今後のテレビ市場のニーズは、65 型を中心とした大型化、4K/8K の高精細化に加え、有機 EL に代表される Ultra HD Premium<sup>※3</sup>に認定された高品位なテレビに移行していくと予想されています。新製品は、テレビなどに用いるフラットパネルディスプレイ製造に用いられる第 8 世代ガラス基板で、高品位な 65 型パネルを、高い生産性で量産できます。

**■ 解像力 2.0 マイクロメートルで 65 型パネルの一括露光を実現**

キヤノンの FPD 露光装置は、ミラー光学系の一括露光方式「ミラープロジェクション」を採用しており、広い露光フィールドで大型パネルを効率的に生産することが可能です。新たに開発したミラー光学系、独自の加工技術により、従来機種「MPAsp-H803T」（2013 年 6 月発売）と同等の解像力 2.0 マイクロメートル（L/S）を維持したまま、従来機種では最大 58 型だった一括露光範囲を 65 型まで広げました。これにより、従来機種と比較して 65 型パネルを露光するタクトタイムを約 37%短縮<sup>※4</sup>しました。

**■ オーバーレイ精度の向上**

プロセスの高精細化に伴い、オーバーレイ精度（重ね合わせ精度）が非常に重要になります。このオーバーレイ精度を悪化させている要因がプロセスで発生する非線形成分（ゆがみ成分）です。これに対応できる倍率補正技術と、同時多点アライメントシステムの組み合わせにより、オーバーレイ精度が従来機種に比べて約 10%向上しました。

**■ デュアルライン構成による効率的な MMG<sup>※5</sup> 対応が可能**

1 台の塗布現像装置<sup>※6</sup>に対し FPD 露光装置 2 台を並べるデュアルラインを構成することにより、ガラス基板に異なるサイズのパネルを配置できる MMG 対応時の生産効率が向上します。従来機種「MPAsp-H803T」との構成もでき、第 8 世代ラインでラインタクトを崩さずに量産できます。

※1 2,200×2,500mm サイズのガラス基板で、主にテレビ用ディスプレイの製造に用いられる。

※2 Line and Space の略。

※3 Ultra High Definition プラットフォームの統合された基準を作るために設立された UHD Alliance が定める基準をすべて満たしたディスプレイなどに与えられる認定名称。

※4 第 8 世代ガラス基板で 65 型を 3 パネル露光するタクトタイムの比較において。

※5 Multi Module on Glass の略。1 枚のガラス基板上に異なるサイズのパネルを配置する方式。ガラス基板の使用効率が向上する。

※6 露光前にフォトレジストをガラス基板の表面に塗り、露光後に現像液にひたして余分なフォトレジストを取る装置。

- 一般の方のお問い合わせ先 : キヤノン株式会社 光学機器事業本部 03-5732-8776（直通）  
光機営業統括センター 第一営業部
- キヤノン産業機器ホームページ : [canon.jp/semiconductor](http://canon.jp/semiconductor)